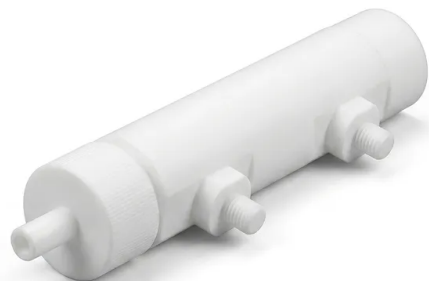


半導体・ポリシリコン産業向け 高純度カスタムPtfe製反応セル・電解槽

商品番号: PL-CP108



前書き

半導体・ポリシリコン製造向けに設計されたカスタム PTFE 製反応セル・電解槽をご紹介します。耐食性を備えたこれらの装置は、微量分析・化学処理において高純度を確保し、要求の厳しい実験・産業用途に対し比類のない耐久性と熱安定性を提供します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
半導体ウェーハ洗浄	フォトリソグラフィ工程におけるシリコンウェーハの超純度酸洗浄用のカスタム槽として使用されます。	金属イオン汚染を防止します。
ポリシリコン化学気相成長	ソーラーグレード・電子グレードシリコンの生産で使用する試薬を扱うための高純度容器です。	高純度前駆体の完全性を維持します。
電気化学研究	新しいバッテリー化学・金属メッキプロセスを試験するためのカスタムビルドの電解セルです。	容器壁との副反応を排除します。
微量金属分析	環境試験において兆分の1の純度レベルが要求される試料の保管・反応容器です。	市場で最も低い浸出特性を実現します。
プラズマエッチング支援	プラズマチャンバー内で使用され、敏感な計測機器を保護するための部品シュラウド・プロテクターです。	プラズマ侵食に対して優れた耐性を発揮します。
腐食性流体の移送	フッ化水素酸・その他の強力なエッチング剤を扱うためのカスタムマニホールド・反応槽です。	作業者の安全性と装置寿命を最大化します。
高温合成	強力な有機触媒を使用する水熱・還流工程向けの反応容器です。	高温下での連続運転が可能です。
特注実験環境	自動センサー・流体コントローラーと統合できるよう設計された特殊な反応装置です。	既存の設備へのシームレスな統合が可能です。

パラメータグループ	仕様詳細	製品品番
素材構成	高純度バージン PTFE / PFA（顧客要求に応じる）	PL-CP108
寸法仕様	完全カスタマイズ可能 / 顧客提供の技術図面に応じる	PL-CP108
ポート構成	カスタムネジ付きポート、フランジ、またはテーパジョイント	PL-CP108
温度定格	素材の耐熱限界（用途別）	PL-CP108
耐薬品性	万能（高温下の溶融アルカリ金属・フッ素を除く）	PL-CP108
製造方法	精密CNC加工 & カスタム旋盤加工	PL-CP108
表面仕上げ	残渣を最小限に抑える高品質平滑仕上げ	PL-CP108
蓋設計	ボルト締め、ネジ式、または圧入式のカスタムオプション	PL-CP108
容積容量	産業・実験室の特定の要求に合わせて調整可能	PL-CP108
肉厚	圧力・熱要求に応じて設計	PL-CP108